Анализ релаксации фототока полуизолирующего GaAs в области температур 150–200 К

© А.П. Одринский ¶

Институт технической акустики Национальной академии наук Белоруссии, 210017 Витебск, Республика Белоруссия

(Получена 5 февраля 2014 г. Принята к печати 3 июня 2014 г.)

Рассмотрены особенности регистрации вклада характерного собственного дефекта полуизолирующего GaAs в релаксацию фототока. Представлен подробный анализ кинетики релаксации на основе аппроксимации суммой экспоненциальных составляющих. Результаты сравниваются с данными фотоэлектрической релаксационной спектроскопии.

1. Введение

Дефекты кристаллической структуры арсенида галлия интенсивно исследовались в процессе становления и развития полупроводниковой электроники [1-4]. В настоящее время, с расширением сферы его применения (формирование различного типа полупроводниковых структур квантовой электроники, опто- и микроэлектроники террагерцового диапазона, фотовольтаики и т.д.), они продолжают вызывать интерес [4-6]. Вместе с тем глубокоуровневые дефекты в данном материале, включая собственные дефекты GaAs, изучены недостаточно [7]. Особенно это касается полуизолирующего материала, где значительное удельное сопротивление не позволяет использовать электрические способы возбуждения кристалла полем либо током для неравновесного заполнения дефектов. Здесь эффективно используют фотоэлектрическую релаксационную спектроскопию (PICTS [2]) — вариант нестационарной спектроскопии глубоких уровней (DLTS [8]) с возбуждением образца светом. На таких материалах существует также отмечавшаяся еще в ранних работах [4] проблема сопоставления данных PICTS [3] с DLTS-исследованиями низкоомного GaAs. Так, в ряде исследований электрически активных дефектов арсенида галлия различными вариантами нестационарной спектроскопии (DLTS [1], DLOS [9], PICTS [2,10,11]) в области температур 150-200 К наблюдали перезарядку дефекта известного как EL6. Вместе с тем в РІСТЅ исследованиях при данных температурах отмечаются не экспоненциальный характер релаксации фототока [12], а также наложение сигнала перезарядки нескольких дефектов [4,13,14]. В настоящей работе представлен подробный анализ регистрации перезарядки глубокоуровневых дефектов полуизолирующего GaAs в области температур 150-200 K, соответствующей регистрации характерного, наряду с EL2, собственного дефекта арсенида галлия [10,15].

2. Условия эксперимента

Омические контакты формировались пайкой индием в планарной конфигурации на освещаемой поверхности 5 × 10 мм образца пластины марки АГ4П (легирована индием и хромом, удельное сопротивление $\rho \sim 7 \cdot 10^7 \, \mathrm{Om} \cdot \mathrm{cm}$). Качество контактов оценивали по вольт-амперной характеристике, которая была линейна при комнатной температуре. Световое возбуждение падало перпендикулярно поверхности образца и соответствовало плотности потока фотонов $\sim 10^{14} \, {\rm cm}^{-2} {\rm c}^{-1}$. Механический модулятор задавал частоту возбуждения 25 Гц при отношении длительности светового интервала к темновому 1:4. Использовалось квазимонохроматическое возбуждение с $hv_0 = 1.22 \, \text{эВ}$ (излучение ксеноновой лампы ДКСШ-500, прошедшее монохроматор типа МСД-1 при ширине входной и выходной щели 4 мм, что соответствовало диапазону энергий фотонов $\Delta h v \sim 0.06 \, \text{sB}$). Наложение от других порядков дифракционной решетки убиралось соответствующими светофильтрами. Образец крепился на массивном алюминиевом держателе оптического криостата, резистивный нагреватель которого обеспечивал скорость нагрева ~ 2 К/мин. Измерительная установка, методики регистрации и анализа данных подробно описаны в [16]. Регистрация проводилась в процессе нагрева образца в диапазоне температур 78-330 K, с шагом 1 K. При регистрации релаксации фототока проводилось поточечное накопление и усреднение кинетики релаксации (64 реализации), содержащей 2000 отсчетов, расположенных через фиксированный интервал времени $\Delta t = 1.625 \cdot 10^{-5}$ с. Анализ проводился в диапазоне характеристических времен релаксации $10^{-2} - 10^{-4}$ с.

3. Анализ результатов

В PICTS спектрах образца, представленных на рис. 1, доминировал отмеченный стрелкой пик. Расположенный относительно обособлено, он отчетливо прослеживается на наборе спектров, соответствующих характеристическому времени релаксации $10^{-2}-10^{-4}$ с. На рисунке можно заметить асимметрию пика в виде полки на низкотемпературном крыле, что предполагает наличие в релаксации фототока вклада от нескольких дефектов. Используя построение спектров на основе функций улучшенного разрешения,¹ выделить вклады отдельных

[¶] E-mail: odra@mail333.com

 $^{^{1}}$ Функция типа "square wave" [17].

составляющих не удалось. Для разделения вкладов, следуя подходу работы [11], мы применили аппроксимацию зарегистрированной кинетики релаксации фототока суммой нескольких экспоненциальных составляющих. Аппроксимация проводилась последовательно в каждой температурной точке из области температур регистрации пика — $\Delta_0 T$. Использовался специально развитый программный модуль для итерационного определения параметров модели методом согласованного градиентного спуска с возможностью изменения соотношения масштабов приращений параметров в процессе подгонки. Получаемая в результате аппроксимации модельная кривая визуально хорошо описывала форму экспериментальной кривой. На рис. 2 представлены изменения с температурой показателя степени и амплитуды экспоненциальных составляющих, полученных в результате аппроксимации кинетики релаксации суммой 2-х (использован временной интервал кинетики релаксации 2-30 мс) и 3-х экспонент (на всем интервале времени регистрации релаксации 0-30 мс). Для оценки точности аппроксимации рассчитывалось среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma = [\mathbf{N}^{-1} \Sigma_{k=1}^{\mathbf{N}} (\mathbf{Y}(t_k) - \mathbf{F}(t_k))^2]^{1/2}, \tag{1}$$

где $F(t_k)$ — экспериментально зарегистрированная кинетика спада фототока, $Y(t_k)$ — модельная функция, k = 1, ..., N — номер узла, а N — число узлов дискретизации по времени, используемых при аппроксимации. Зависимость σ от температуры представлена на рис. 3. Заметно, что переход от 2 к 3 экспоненциальным компонентам дает уменьшение среднеквадратичного отклонения приблизительно на порядок. Поскольку дальнейшее увеличение числа компонент не давало снижения среднеквадратичного отклонения, преимущественно обусловленного присутствием определенного уровня шума в зарегистрированной кинетике, в последующем



Рис. 1. PICTS спектры GaAs, соответствующие характеристическому времени релаксации: *1* — 10, *2* — 3.4, *3* — 0.9, *4* — 0.34, *5* — 0.12 мс. Спектры нормированы по высоте максимального пика и для наглядности последовательно смещены вдоль вертикальной оси.



Рис. 2. Изменение с температурой амплитуды (a) и показателя степени (b) экспоненциальных составляющих кинетики релаксации фототока. Зависимости соответствуют: $1 - \alpha$ -компоненте, $2 - \beta$ -компоненте, $3 - \gamma$ -компоненте, 4 -оценке $1/\tau$ по начальному наклону кривой спада.

анализе в основном использовали² модельную функцию:

$$Y(t) = A_0 \exp(-\alpha t) + B_0 \exp(-\beta t) + D_0 \exp(-\gamma t) + C_0,$$
(2)

где $\alpha < \beta < \gamma$.

На рис. 2 заметны изменения характера зависимости параметров модели от температуры. Можно выделить низкотемпературный участок 140–168 К, обозначим его I, и высокотемпературный — II при T > 168 К. На участке I наблюдается некоторый рост с температурой наименьшего показателя степени α , сменяющийся более сильной зависимостью на участке II. Показатель степени следующей компоненты (назовем β -компонента) практически не изменяется на I участке. Далее, на участке II заметен также рост β , вплоть до значений, сравнимых с наибольшим показателем — γ , что приводило к нестабильной работе алгоритма аппроксимации, связанной с известной проблемой разделения вкладов экспоненциальных составляющих с

 $^{^{2}}$ За исключением высокотемпературного части области $\Delta_{0}T$, где использовалась двухкомпонентная модель.

близкими значениями показателя степени [18]. Компоненту с наибольшим показателем степени — у следует сопоставить с уменьшением концентрации свободных носителей, ограничивающим обнаружимость возможно присутствующих более быстрых процессов, связанных с релаксацией неравновесного заполнения дефектов. Амплитуда у-компоненты на низкотемпературном крае области $\Delta_0 T$ составляла $\sim 15\%$ общей амплитуды релаксации фототока (см. рис. 2, a). С повышением температуры доля этой компоненты уменьшалась, составляя лишь незначительную часть общего процесса релаксации на высокотемпературном крае $\Delta_0 T$. Учитывая, что использовалось световое возбуждение из области примесного поглощения GaAs, можно считать, что при этих температурах релаксация фототока не содержит существенного вклада, связанного с изменением неравновесного заполнения дефектов, характеризующихся релаксацией более быстрой, чем 1/т_n, и основную долю релаксации фототока составляют компоненты с показателями степени < у. На рис. 2, в приведена также оценка величины $1/\tau_n$ по начальному участку кинетики релаксации, где τ_n — время жизни свободных носителей. Эта оценка занижена в сравнении с величиной у, что хорошо согласуется с использованным характером фотовозбуждения из области примесного поглощения, с энергией фотонов, меньшей ширины запрещенной зоны. В этих условиях основным поставщиком неравновесных свободных носителей является изменение зарядового состояния дефектов при освещении. Соответственно можно полагать, что процесс релаксации также будет содержать значительную составляющую термоэмиссии с дефектов, в том числе и в начальный момент после прекращения фотовозбуждения, что объясняет разницу в значениях γ и $1/\tau_n$.

Зависимость от температуры показателя степени более медленных α - и β -компонент релаксации при температуре выше $\sim 168 \text{ K}$ (II участок) типична для



Рис. 3. Оценка точности аппроксимации кинетики релаксации фототока модельной функцией — суммой постоянной составляющей и *1* — двух, *2* — трех, *3* — четырех экспоненциальных компонент.



Рис. 4. Зависимость от температуры характеристического времени перезарядки дефекта с учетом T^2 коррекции: I — по данным PICTS и аппроксимации модельной функцией, 2 — для α -компоненты, 3 — для β -компоненты.

термоэмиссии неравновесного заполнения дефекта. На рис. 4 представлено сравнение данных аппроксимации и PICTS-анализа. Заметно хорошее соответствие графика Аррениуса с таковым для *β*-компоненты в области температур выше ~ 168 К. При T > 180 К, где амплитуда *β*-компоненты существенно снижается, заметна тенденция графика Аррениуса на сближение с добавочной α-компонентой, обнаруженной аппроксимацией. Таким образом, изменение с температурой кинетики релаксации фототока при температурах выше ~ 168 K можно представить как обусловленную вкладом термоэмиссии с двух дефектов, с близкими значениями энергии термоактивации: 364 мэВ для *β*-компоненты и 364 мэВ для α -компоненты. Это обстоятельство, а также убывающий характер зависимости от температуры амплитуды β -компоненты на II температурном участке (см. рис. 2, a) вызывает сомнения в независимом характере обнаруженных процессов термоэмиссии, или, иными словами, возможности сопоставления их и релаксации неравновесного заполнения независимых дефектов, типа ловушек. Действительно, для случая релаксации неравновесного заполнения n_1 и n_2 двух ловушек различной природы вследствие термоэмиссии, кинетику процесса в приближении пренебрежения перезахватом и линейной рекомбинации можно описать системой дифференциальных уравнений:

$$dn_1/dt = -e_1 \cdot n_1, \tag{3}$$

$$dn_2/dt = -e_2 \cdot n_2, \tag{4}$$

$$dn/dt = -n/\tau + e_1 \cdot n_1 + e_2 \cdot n_2, \tag{5}$$

где n — концентрация свободных носителей, τ — время жизни свободных носителей, e_1 и e_2 — скорости термоэмиссии с соответствующих дефектов. Решение (3) и (4) представимо:

$$n_i(t) = n_{i0} \exp(-e_i t), \tag{6}$$

где i = 1, 2. Здесь n_{i0} — заполнение дефекта неравновесными носителями заряда на момент прекращения

фотовозбуждения. Тогда изменение концентрации свободных носителей

$$n(t)/n_0 = (1 - B_1 - B_2) \exp(-t/\tau) + B_1 \exp(-e_1 t) + B_2 \exp(-e_2 t), \quad (7)$$

где n_0 — концентрация неравновесных свободных носителей в условиях стационарного фотовозбуждения, и введено обозначение соответствующих амплитуд:

$$\mathbf{B}_{i} \equiv (n_{i0}e_{i}/n_{0})/(1/\tau - e_{i}).$$
(8)

При условии достижения состояния стационарного фотовозбуждения³ dn_t/dt , dn/dt = 0 можно считать:

$$n_0 = g_l \tau, \ n_{i0} = N_1 / (1 + (e_i + e_{in}^0) / e_{ip}^0,$$
 (9)

где e_{in}^0 и e_{ip}^0 — скорости оптического опустошения и заполнения дефекта. Подставляя n_0 , n_{i0} в (8) и пренебрегая не зависящим от температуры темпом оптического опустошения e_{in}^0 , получим

$$\mathbf{B}_{i} = (\mathbf{N}_{i}e_{i}/g_{l})/[(1+e_{i}/e_{i}^{0})(1-e_{i}\tau)].$$
(10)

В области температур регистрации перезарядки $\Delta_0 T$, при изменении e_i от значений, близких к нулю до меньших, но сравнимых с $1/\tau$, функция B_i возрастает и не имеет экстремумов. Таким образом, убывающий характер температурной зависимости амплитуды β -компоненты (см. рис. 2, *a*) плохо согласуется с интерпретацией этой компоненты релаксации как обусловленной термоэмиссией с независимого дефекта.

Полученное значение энергии активации термоэмиссии для α- и β-компонент не значительно отличается от таковой для EL6 — 0.35 эВ по данным DLTS на низкоомном GaAs [1]. Сложный характер релаксации неравновесного заполнения глубокоуровневых дефектов в рассматриваемой области температур 150-200 К отмечался и в DLTS исследованиях низкоомного GaAs [15,19], где обнаруживалась некоторая связанность дефектов, регистрируемых в относительно узкой области температур, фактически совместно. Это дало основания объединить их в группу дефектов EL6 [15,20]. В свете вышесказанного обнаруженный в настоящей работе сложный характер релаксации фототока не является значительным исключением. Если полагать корректной работу процедуры аппроксимации на низкотемпературном участке $\Delta_0 T$, где величина 1/α становится сравнимой с длительностью темнового периода регистрации кинетики релаксации, что планируется выяснить в дальнейших исследованиях, изменение характера температурной зависимости показателей степени экспоненциальных компонент релаксации можно объяснить участием дополнительного к термоэмиссии механизма изменения неравновесного заполнения дефекта. В любом случае убывание с нагревом амплитуды β -компоненты (см. рис. 3, *a*) на высокотемпературном участке $\Delta_0 T$ не согласуется с предположением регистрации независимого процесса термоэмиссии.

oronouou

4.

Заключение

изменений с температурой кинетики релаксации фототока на основе аппроксимации модельной функцией в данной области температур обнаружило сложный характер процесса релаксации, который можно представить двумя экспоненциальными компонентами, сопоставимыми с термоэмиссией. Их относительные вклады в регистрируемый сигнал релаксации изменялись с температурой. Характер температурных зависимостей параметров экспоненциальных компонент не поддается интерпретации как процесс термоэмиссии с независимых локальных уровней.

Таким образом, в отличие от работы [11], мы получили хорошее соответствие результатов распространенного DLTS-анализа и анализа на основе аппрокси-

мации модельной функцией суммы экспоненциальных

составляющих релаксации фототока, по крайней мере

на высокотемпературном крае рассмотренной области

регистрации перезарядки дефектов. Подробное изучение

Список литературы

- G.M. Martin, A. Mitonneau, A. Mircea. Electron. Lett., 13 (7), 191 (1977).
- [2] Ch. Hurter, M. Boilou, A. Mitonneau, D. Bois. Appl. Phys. Lett., 32, 821 (1978).
- [3] J.C. Bourgoin, H.J. von Bardeleben, D. Stievenard. J. Appl. Phys., 64, 65 (1988).
- [4] J.C. Abele, R.E. Kremer, J.S. Blakemore. J. Appl. Phys., 62 (6), 2432 (1987).
- [5] Jun Xia, Andreas Mandelis. Semicond. Sci. Technol., 24, 125 002 (2009).
- [6] E.I. Shmelev, A.V. Klyuev, A.V. Yakimov. Fluctuation and Noise Lett., 12, 1350 008 (2013).
- [7] E.G. Seebauer, M.C. Kratzer. *Charged Semiconductor Defects* (London, Springer Verlag, 2009).
- [8] D.V. Lang. J. Appl. Phys., 45, 3023 (1974).
- [9] A. Chantre, G. Vincent, D. Bois. Phys. Rev. B, 23, 5335 (1981).
- [10] K. Yasutake, H. Kakaiuchi, A. Takeuchi, K. Yoshii, H. Kawabe. J. Mater. Sci. Mater. Electron., 8, 239 (1997).
- [11] J.S.P. Maria Brasil, P. Motisuke. J. Appl. Phys., 68 (7), 3370 (1990).
- [12] P.K. Giri, Y.N. Mohapatra. J. Appl. Phys., 78 (1), 262 (1995).
- [13] C. Longeaud, J.P. Kleider, P. Kaminski, R. Kozlowski, M. Pawlowski, J. Cwirko. Semicond. Sci. Technol., 14, 747 (1999).
- [14] A. Castaldini, A. Cavallini, L. Polenta, C. Canali, F. Nava. Proc. 5th Eur. Gallium Arsenide and related III-V compaunds Applications Simpos. (Bologna, Italy, 1997) p. 315.
- [15] C.V. Reddy, Y.L. Luo, S. Fung, C.D. Beling. Phys. Rev. B, 58, 1358 (1998).
- [16] И.А. Давыдов, А.П. Одринский. Деп. в ВИНИТИ 27.06.90, № 6285-В90 (М., 1990).
- [17] A.A. Istratov, O.F. Vyvenko, H. Hieslmair, E.R. Weber. Meas. Sci. Technol., 9, 477 (1998).
- [18] A.A. Istratov, O.F. Vyvenko. Rev. Sci. Instrum., 70 (2), 1233 (1999).

 $^{^3}$ Отметим, что при выбранных условиях светового возбуждения, на II участке $\Delta_0 T$ насыщение фототока наблюдалось.

- [19] H. Shiraki, Y. Tokuda, K. Sassa. J. Appl. Phys., 84, 3167 (1998).
- [20] A. Cavallini, L. Polenta. J. Appl. Phys., 98, 023 708 (2005).

Редактор А.Н. Смирнов

The analysis of photocurrent relaxation of semi-insulating GaAs in the temperature range 150–200 K

A.P. Odrinsky

Institute Technical acoustics National Academy of Sciences Belarus, 210717 Vitebsk, Belarus

Abstract The peculiarities of the registration of a contribution of characteristic native defect in semi-insulated GaAs to the photocurrent relaxation are considered. Detailed analysis of transient relaxation on the basis of approximation by sum exponential components is presented. The data of photo-induced current transient spectroscopy are comparing with results of approximation.